

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-221989

(43)公開日 平成6年(1994)8月12日

(51)Int.Cl.⁵

G 0 1 N 15/14
15/02
21/53

識別記号 P 6928-2 J
A 6928-2 J
Z 7370-2 J

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 1 FD (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平5-32817

(22)出願日

平成5年(1993)1月27日

(71)出願人 000115636

リオン株式会社

東京都国分寺市東元町3丁目20番41号

(72)発明者 持地 秀明

東京都国分寺市東元町3丁目20番41号リオン株式会社内

(72)発明者 阿部 孝

東京都国分寺市東元町3丁目20番41号リオン株式会社内

(74)代理人 弁理士 田辺 恵基

(54)【発明の名称】光散乱式微粒子検出装置

(57)【要約】

【目的】レーザ光源を安定動作させることにより粒子検出精度を向上させる。

【構成】レーザ光源3から出射する光源光LA1をフローセル2に入射させる構成として、戻り光LA11及びLA12がレーザ光源3に戻らないようにフローセル2を傾けるように位置決めする。かくして比較的大きい光エネルギーを有する光源光LA1が反射することにより生ずる戻り光LA11及びLA12の影響を受けないようにレーザ光源3の出力を安定化することができることにより、異常カウント動作をさせないようにできる。

